

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 1 区分

【発行日】平成25年11月7日(2013.11.7)

【公開番号】特開2012-11372(P2012-11372A)

【公開日】平成24年1月19日(2012.1.19)

【年通号数】公開・登録公報2012-003

【出願番号】特願2010-269960(P2010-269960)

【国際特許分類】

B 0 1 D 53/86 (2006.01)

B 0 1 J 35/02 (2006.01)

B 0 1 J 37/02 (2006.01)

B 0 1 J 37/34 (2006.01)

B 0 1 D 53/94 (2006.01)

C 0 1 B 17/78 (2006.01)

B 0 1 D 53/60 (2006.01)

B 0 1 D 53/74 (2006.01)

B 0 1 D 53/14 (2006.01)

【F I】

B 0 1 D 53/36 Z A B J

B 0 1 J 35/02 J

B 0 1 J 37/02 3 0 1 K

B 0 1 J 37/34

B 0 1 D 53/36 1 0 2 D

B 0 1 D 53/36 D

B 0 1 D 53/36 G

C 0 1 B 17/78

B 0 1 D 53/34 1 3 2 Z

B 0 1 D 53/14 1 0 2

【手続補正書】

【提出日】平成25年9月18日(2013.9.18)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

気相中の有害物質として、高濃度の窒素酸化物や硫黄酸化物が共存する環境下においては、第 1 次側の装置として窒素酸化物を除去する薬剤としてアミン化合物水溶液を用いるとともに、第 2 次側の装置として、光触媒材料と希薄な過酸化水素溶液の共存下で処理する分解方法にて硫黄酸化物を除去する方法。

【請求項 2】

前記アミン化合物が、トリエタノールアミン、メチルアミン及びモルホリンから選ばれる化合物であることを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 3】

気相中の有害物質である硫黄酸化物から、硫酸を作製する請求項 1 または 2 記載の方法。

【請求項 4】

前記光触媒材料が、金属チタン又はチタン合金表面にチタン窒化物を形成させた後、陽極

酸化処理することにより得られた結晶性酸化チタン皮膜を有する光触媒材料であることを特徴とする請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載の方法。

【請求項 5】

前記結晶性酸化チタンが、アナターゼ型酸化チタンであることを特徴とする請求項 4 に記載の方法。

【請求項 6】

前記希薄な過酸化水素溶液の過酸化水素濃度が、1 重量 % 以下であることを特徴とする請求項 1 ~ 5 のいずれかに記載の方法。